

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
H01L 21/18

(11) 공개번호 특1997-0077129
(43) 공개일자 1997년 12월 12일

(21) 출원번호	특1996-0016220
(22) 출원일자	1996년 05월 15일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지 김회재 경기도 용인시 기흥읍 농서리 산 24번지

심사청구 : 없음

(54) 반도체 가스공급 시스템

요약

가스공급원에서 진공챔버에 공급되는 가스의 양 및 흐름을 단속하는 밸브의 구조를 개선하는 반도체 가스공급 시스템에 관한 것이다.

본 발명은, 가스공급원에서 공급되는 가스가 에어밸브 및 니들밸브를 통과하여 진공챔버에 공급되도록 구성된 반도체 가스공급 시스템에 있어서, 상기 에어밸브는 에어공급원에서 공급되는 에어가 소용량의 솔레노이드 밸브를 통과하여 공급됨으로서 개폐동작을 수행함을 특징으로 한다.

따라서, 진공챔버에 공급되는 가스를 용이하게 제어하여 수율이 향상되는 효과가 있다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

반도체 가스공급 시스템

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 따른 반도체 가스공급 시스템의 일실시예를 나타내는 도면이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

가스공급원에서 공급되는 가스가 에어밸브 및 니들밸브를 통과하여 진공챔버에 공급되도록 구성된 반도체 가스공급 시스템에 있어서, 상기 에어밸브는 에어공급원에서 공급되는 에어가 소용량의 솔레노이드 밸브를 통과하여 공급됨으로서 개폐동작을 수행함을 특징으로 하는 반도체 가스공급 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 니들밸브는 소형으로서 표면에는 상기 가스의 흐름량을 나타내는 눈금장치가 부착됨을 특징으로 하는 상기 반도체 가스공급 시스템.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 에어밸브의 상단에는 스티커가 부착됨을 특징으로 하는 상기 반도체 가스공급 시스템.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개되는 것임.

도면

도면2

